УДК 621.382.27

ЛАВИННО-ПРОЛЕТНЫЙ ДИОД С ВАРИЗОННОЙ ОБЛАСТЬЮ УМНОЖЕНИЯ

В. М. АРУТЮНЯН, Л. Н. ГРИГОРЯН, С. Г. ПЕТРОСЯН

Ереванский государственный университет-

(Поступила в редакцию 27 сентября 1984 г.)

Теоретически исследованы статические и динамические характеристики лавинно-пролетных диодов с варизонной областью умножения. Вычислена зависимость малосигнального импеданса диода от градиента ширины запрешенной зоны.

Плавное пространственное изменение параметров варизонного полупроводника, как известно [1—3], позволяет управлять процессом ударной ионизации и коэффициентом усиления тока в различных лавинных гетероструктурах. В сочетании с легированием изменение состава полупроводника может привести к заданному оптимальному распределению параметров лавинных структур. В частности, имеется возможность для полного разделения областей умножения и дрейфа в лавинно-пролетных диодах (ЛПД). Именно эта концепция лежит в основе работы гетеропереходного ЛПД, предложенного впервые в [4]. Однако практическая реализуемость преимуществ гетеропереходных ЛПД довольно проблематична в связи с тем, что не всегда возможен выбор гетеропереходной пары с заданными ионизационными свойствами, одновременно удовлетворяющей условиям идеальности гетероперехода.

Наличие граничных состояний в области сильного поля приводит к возникновению большого избыточного тока насыщения, разрушающего работу $\Lambda\Pi A$. Для устранения этого эффекта требуется, по крайней мере, уменьшить несоответствие постоянных решеток до 10^{-3} A[4]. В значительной степени эту трудность можно обойти, используя плавный переход по составу от области умножения к области дрейфа в $\Lambda\Pi A$. Здесь мы рассматриваем влияние такой варизонности на статические и динамические характеристики $\Lambda\Pi A$.

Пусть имеется структура типа диода Рида с варизонной областью умножения (рис. 1), в которой ширина запрещенной зоны в области — $W \leqslant x \leqslant 0$ плавно меняется по линейному закону: $E_g(x) == E_g(0) + |\nabla E_g| x$. Знак и величина градиента ширины запрещенной зоны, как будет видно из дальнейших расчетов, существенно влияют на работу ЛПД. Для конкретности в работе рассматривается наиболее интересный случай, когда направления градиентов электрического поля и ширины запрещенной зоны совпадают, так что в области максимального поля (граница раздела $p_{вар}$ - n^+) $E_g(x)$ минимальна. При незначительной концентрации акцеп-

134

торов в p_{sap} -области для $\Lambda \Pi A$ фактически имеем p^+ -*i*- n^+ -структуру, часть запорного слоя которой является варизонной. Известно, что как статическая вольт-амперная характеристика лавинного диода, так и его высокочастотные свойства значительно изменяются при изменении размеров области интенсивной ударной ионизации и переходе от узкого слоя умножения, локализованного в плоскости максимального поля или минимальных коэффициентов ударной ионизации, к умножению, равномерно распределенному по всему запорному слою.

В предлагаемых структурах локализация ударной ионизации может иметь место не только за счет неоднородности поля, но и за счет неоднородности ширины запрещенной зоны. На рис. 1 показано распределение ширины запрещенной зоны и электрического поля в структурах типа



Рис. 1. Пространственное распределение в ЛПД: ширины запрещенной зоны (a), напряженности электрического поля ($6 - p^+$ -*i*-*i*-*i*вар- n^+ , $s - p^+$ -*i*- $p_{\text{вар}}$ - n^+) в коэффициента ударной нонизации (*i*).

 $p^+-i-i_{Bap}-n^+$ и $p^+-i-p_{Bap}-n^+$ при обратных смещениях, близких к пробойному, когда *i*- или p_{Bap} -области полностью обеднены свободными носителями. При однородном легировании p_{Bap} -области поле в этой области увеличивается по закону



Рис. 2. Изменение с праднентом ширины запрещенной зоны напряженности пробоя E_0 (1, 2) (левая шкала) и толщины слоя умножения x_A (1', 2') (правая шкала) для структур $p^{+}-i - i_{BBP} - n^+$ (1, 1') и $p^{+}-i - p_{BBP} - n^+$ (2, 2'); L = 4 мкм, W = 1 мкм, $N = 10^{16}$ см⁻³.

 $E(x) = E_0 - eNx/\epsilon\epsilon_0$, где N — концентрация акцепторов, а E_0 — напряженность поля в *i*-слое, величина которой определяется из условия пробоя

$$\int_{-\infty}^{\infty} \alpha(x, E(x)) dx = 1.$$
 (1)

В локальном приближении [1] коэффициенты ударной ионизации для электронов и дырок (для простоты расчетов они полагаются равными) можно представить в виде

$$\alpha(x, E(x)) = \alpha_0 \exp\left(-\gamma \frac{E_{\mathcal{E}}(0) + |\nabla E_{\mathcal{E}}| x}{E_0 + \frac{eN}{\epsilon\epsilon_0} x}\right), \qquad (2)$$

где у — коэффициент, определяемый эффективными массами и длиной свободного пробега электронов и дырок, которые слабо меняются с изменением состава.

После подстановки (2) в (1) получается следующее уравнение для определения напряженности поля пробоя:

$$a_{0}'L \exp\left(-\frac{1}{E_{0}}\right) + a_{0}'A \frac{E_{0}}{N'} \exp\left(\frac{v}{N'}\right) \left\{ \operatorname{Ei}\left(-A\right) - \operatorname{Ei}\left(-\frac{A}{1+\frac{N'}{E_{0}}}\right) + \frac{1}{A} \exp\left(-A\right) + \frac{1+\frac{N'}{E_{0}}}{A} \exp\left(-\frac{A}{1+\frac{N'}{E_{0}}}\right) \right\} = 1,$$
(3)

где $A = (N' + vE_0)/N'E_0$, $N' = eNW/\gamma \varepsilon_0 E_g(0)$, E_0 — безразмерное поле, $v = |\nabla E_g| W/E_g(0)$ — относительное изменение ширины запрещенной зоны, L — отношение длины пролетного пространства к длине варизонной области, a'_0 — безразмерный коэффициент, а Ei(x) = $\int_{0}^{x} t^{-1}e^t dt$.

Приведенное уравнение решается численно при различных значениях градиента ширины запрещенной зовы и легирования $p_{\rm sap}$ -области. При $N \to 0$ из (3) получается соответствующее уравнение для $p^+-i-i_{\rm sap}-n^+$ -диода.

Толщина слоя умножения определяется из общепринятого для АПД условия [4, 5]

$$\int_{-W}^{-x_A} \alpha(x, E(x)) \, dx = 0.95. \tag{4}$$

Это уравнение для p^+ -*i*-*i*_{вар}- n^+ -диода решается аналитически при малых $|\nabla E_{g}|$, когда выполняется условие $z'_0 L \exp\left(-\frac{1}{E_0}\right) > 0,05$, а слой умножения охватывает всю варизонную область и часть *i*-области, причем

$$x_{A} = L - \frac{0.05}{a'_{0}} \exp\left(\frac{1}{E_{0}}\right).$$
(5)

При больших $|\nabla E_g|$ толщина слоя умножения уменьшается и становится меньше W. В этом случае x_A изменяется с ростом $|\nabla E_g|$ по закону

$$x_{A} = \frac{E_{0}}{v} \ln \left(e^{v/E_{0}} - \frac{0.95}{a_{0}} \frac{v}{E_{0}} e^{1/E_{0}} \right).$$
(6)

Зависимости $E_0(|\nabla E_g|)$ и $x_A(|\nabla E_g|)$ представлены на рис. 2. Кривые 1, 1' относятся к структуре p^+ -*i*-*i*_{вар}- n^+ , а 2, 2' — к структуре p^+ -*i*- $p_{вар}$ - n^+ . Из этих графиков следует, что даже при отсутствии легирования варизонного слоя возможны пространственная локализация ударной ионизации и полное разделение запорного слоя на области дрейфа и умножения. С увеличением $|\nabla E_g|$ уменьшается средняя ширина запрещенной зоны в слое умножения, и поэтому поле пробоя также уменьшается. При наличии же в варизонном слое ионизированных акцепторов локализация процесса ударной ионизации является более сильной и обусловлена как неоднородностью поля, так и E_g . При расчете этих кривых для параметров γ , α_v , E_g (0) нами использовались численные значения, характерные для твердых растворов $Ga_x Al_{1-x} As$ [6].

Зная распределение внешнего поля по структуре, можно оценить также КПД ЛПД по известной формуле

$$\eta = \frac{1}{\pi} \left(1 - \frac{U_A}{U_0} \right),$$

где U₀ и U_A — падения напряжения на всем запорном слое и на слое умножения. Для η легко получить выражение

$$\eta = \frac{1}{\pi} \frac{L + 1 - x_A + \frac{N'}{2E_0} (1 - x_A)^2}{L + 1 + \frac{N'}{2E_0}}$$

С увеличением $|\nabla E_g|$ КПД диода возрастает. Так, например, при $|\nabla E_g| = 5 \cdot 10^3 \text{ вB/см} \eta$ достигает 17% для $p^{+}-i-i_{sap}-n^+$ и 27% для $p^{+}-i-p_{sap}-n^+$.

Эная статические характеристики, можно перейти к анализу динамических свойств рассматриваемых структур. В линейном приближении, когда все переменные составляющие малы по сравнению с постоянными составляющими, задачу можно решить до конца аналитически. Система уравнений, описывающих динамические процессы в $\Lambda \Pi \mathcal{A}$, включает в себя уравнение непрерывности для электронов и дырок, уравнение Пуассона и уравнение для полного тока. Эта система решается аналогично тому, как это делается для обычных диодов Рида [7, 8]. Не приводя это громоздкое решение, выпишем окончательное выражение для малосигнального импеданса диода $Y(\omega) = G(\omega) + iB(\omega)$:

$$Y(w) = wC \frac{y'(1 - \cos w\tau)}{1 - \cos w\tau + 2y(y - \sin w\tau)} + \frac{y'(2y - \sin w\tau)}{1 - \cos w\tau + 2y(y - \sin w\tau)}$$

$$+ i\omega C \frac{y(y-y)}{1-\cos\omega\tau + 2y(y-\sin\omega\tau)},$$
$$y' = \frac{\omega\tau}{2} \left(1 - \frac{\omega^2\tau^2}{R} \frac{L+x_A}{L+1}\right), \quad y = \frac{\omega\tau}{2} \left(1 - \frac{\omega^2\tau^2}{R}\right),$$

137

 $\tau = (W - x_A)/v_s$ и $\tau = (L + x_A)/v_s$ — соответственно времена дрейфа через слой умножения и пролетное пространство,

$$R = \frac{2 \int_0^0 z^2 (L + x_A)}{\gamma E_{\varepsilon}(0) z \varepsilon_0 \tau_A (L + 1)} \int_{-1}^{\infty} \left(\frac{\partial a}{\partial E}\right)_{E_0} dx,$$

 $C = \epsilon \epsilon_0 / (L + x_A)$ есть емкость области дрейфа, $\int_0^0 - постояявая составляющая полного тока.$

Величина R, по сути дела, характеризует индуктивность лавины и зависит от градиента запрещенной зоны. При услозии $a_0 L \exp\left(-\frac{1}{E_*}\right) > 0,05$ имеем

$$R = \frac{2 z_0 \int_0^0 \tau^2 (L + x_A)}{\gamma E_{\mathcal{E}}(0) z z_0 \tau_A(L+1)} \left[\int_{-1}^0 \frac{1 + v x}{(E_0 - N' x)^2} \times \exp\left(-\frac{1 + v x}{E_0 - N' x}\right) dx + \frac{x_A}{E_0^2} \exp\left(-\frac{1}{E_0}\right) \right],$$

а при обратном соотношении $\alpha_0 L \exp\left(-\frac{1}{E_0}\right) < 0.05 -$

$$R = \frac{2 \alpha_0 \int_0^0 \tau^2 (L + x_A)}{\gamma E_g(0) \varepsilon \varepsilon_0 \tau_A (L + 1)} \int_{-1}^{-x_A} \frac{1 + \upsilon x}{(E_0 - N' x)^2} \exp\left(-\frac{1 + \upsilon x}{E_0 - N' x}\right) dx.$$

Приведенные формулы в пределе $N \rightarrow 0$ непосредственно применимы для расчета импеданса и $p^+-i-i_{ssp}-n^+$ -диода. На рис. 3 и 4 представлены в безразмерных единицах зависимости $G(\omega)$ и $B(\omega)$ для обеих типов





Рис. 3. Зависимость активной $G(\omega)$ (1, 2, 3) и реактивной $B(\omega)$ (1', 2', 3') частей импеданев p^+ -*i*-*i*_{Bap}- $n^+ \lambda \Pi A$ от частоты: $J_0^0 = 50 \text{ A/cm}^2$; 1, 1'-v = 0.5; 2, 2'-v = 0.6; 3, 3'-v = 0.7,

Рис. 4. Зависимость активной $G(\omega)$ (1, 2, 3, 4) и реахтивной $R(\omega)$ (1', 2', 3') частей импеданса p^+ -*i*-рвар⁻-n⁺ $\Lambda \Pi A$ от частоты: $\int_0^0 = 50 \text{ A/cm}^2$, 1, 1'-v=0,02; 2, 2'-v=0,2; 3, 3'-v=0,5; $\int_0^0 = 25 \text{ A/cm}^2$, 4-v=0,2. структур. При $\omega \tau \to 0$ активная часть проводимости положительна, а полная реактивность диода носит индуктивный характер. С увеличением частоты активная проводимость становится отрицательной при $\omega > \omega_{rp}$, причем граничная частота

$$\omega_{\rm rp} = \frac{1}{\tau} \sqrt{\frac{R(L+1)}{L+x_A}}$$

возрастает с ростом $|\nabla E_g|$. В промежутке между ω_{rp} и $\omega_i = 2\pi/\tau G(\omega)$ достигает максимального отрицательного значения. Из графиков видно, что величина $G(\omega)$ в максимуме с ростом $|\nabla E_g|$ существенно возрастает. Величина активной проводимости зависит и от плотности постоянного тока \int_0^0 . Создание варизонности в слое умножения позволяет значительно снизить плотность этого тока при сохранении максимального значения $G(\omega)$ (рис. 4, кривые 2 и 4). Из рисунков следует также, что реактивная проводимость слабо зависит от $|\nabla E_g|$ и при частотах $\omega > \omega_{rp}$ практически определяется емкостью запорного слоя.

Таким образом, создание варизонного слоя улучшает согласование постоянных решеток и позволяет даже в отсутствие неоднородного легирования полностью разделить области лавинного умножения и дрейфа, что приводит к увеличению величины динамического отрицательного сопротивления и эффективности ЛПД с одновременным уменьшением постоянной составляющей общего тока через прибор и ослаблением роли тепловых эффектов.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Арутюнян В. М., Петросян С. Г. ФТП, 14, 2001 (1980).
- Capasso F. et al. Contrib. Papers 9-th Int. Symp. "Gallium Arsenide and Related" Compounds", Oiso, Japan, 1981. Bristol, London, 1982, p. 473-478.
- 3. Баранов А. И. н др. ФТП, 17, 753 (1983).
- Gulshaw B., Gibbin R., Blakey P. Int. J. Electr., 37, 577 (1974); 39, 121 (1975); 40, 521 (1976).
- 5. Classen M., Kapper P., Harth W. Int. J. Electr., 44, 145 (1973).
- 6. Дмитриев А. П., Михайлова М. П., Яссиевич И. Н. ФТП, 17, 46 (1983).
- 7. Тагер А.С., Вальд-Перлов В. М. ЛПД и их применение в технике СВЧ. Изд. Советское радио, М., 1968.
- 8. Пикус Г. Е. Основые теории полупроводиковых приборов. Физматгиз, М., 1965.

ՎԱՐԻՉՈՆԱՑԻՆ ԲԱՉՄԱՑՄԱՆ ՏԻՐՈՒՑԹՈՎ ՀԵՂԵՂԱ-ԹՌԻՉՔԱՑԻՆ ԴԻՈԴ

4. U. LUCOPPSORUSUL, L. L. APPAOPSUL, U. A. APSCOUSUL

Տեսականորեն Հետաղոտված են վարիդոնային բաղմացման տիրույթով Հեղեղա-թռիչբային դիոդների ստատիկ և դինամիկ բնութադրերը։ Հաշվված է սարբի թույլ աղդանշանային իմպեդանսի կախվածությունը արդելված դոտու գրադիենտից։

AN IMPATT DIODE WITH GRADED-GAP AVALANCHE ZONE

V. M. HARUTYUNYAN, L. N. GRIGORYAN, S. G. PETROSYAN

Static and dynamic characteristics of IMPATT diodes with graded-gap avalanchezone are theoretically investigated. The dependence of small-signal impedance of the device on the gradient of band gap has been calculated.